

研究会開催のお知らせ

研究会「第 119 回：新しい単結晶材料の開発に向けた試み」

以下のように研究会を開催いたします。皆様、多数のご参加、お待ち申しあげております。

主催・共催： 日本電子材料技術協会・クリスタルビジネス研究会、日本結晶成長学会・バルク成長分
科会、物質・材料研究機構

日時： 2025 年 10 月 3 日（金）

場所： 物質・材料研究機構 並木地区 共同研究棟 大ゼミナール室（4F）及びオンライン開催

プログラム

・ 13:30-14:10

「高出力 CW レーザーに向けた単結晶素子の開発」

（株）信光社 川嶋一裕

・ 14:10-14:50

「大口径ヘテロエピタキシャルダイヤモンドとデバイスへの応用」

Orbray（株） 金聖祐

・ 14:50-15:30

「SiC 単結晶昇華法における

成長メカニズムの新たな理解と結晶性向上のための考え方」 信越化学工業（株） 美濃輪武久

15:30-15:50 休憩

・ 15:50-16:30

「リラクス系圧電単結晶の開発における最近の進歩」

テイカ（株） 西村輔

・ 16:30-17:10

「SiC, AlN の溶液成長の冶金学的アプローチ」

大阪大学 吉川健

・ 17:10- 意見交換会 共同研究棟 409・410 室（無料）

参加費：

会員種別			
会員(主催・共催団体)	非会員	学生会員(主催・共催団体)	学生非会員
4,000 円	7,000 円	1,000 円	2,000 円

申込・問い合わせ先：日本電子材料技術協会 事務局 [E-mail] jems@jems1962.org

下記記載の上、メールでお申し込みください。

件名： 第 119 回研究会 一般聴講申込

1) 氏名 2) 所属（勤務先） 3) メールアドレス 4) 会員種別 5) 意見交換会の参加有無

参加費お支払い、会議参加のための接続先について

- ・参加費は銀行振込でお願いします。
- ・振込先は、参加申し込みをいただいた後、折り返し、ご連絡させていただきます。
- ・入金確認後、接続先 URL をお送りいたします。

担当：島村清史（物材機構）